

УТВЕРЖДАЮ
 Декан факультета

 (подпись) Суслин А. В.
 ФИО
 «___» _____ 20__

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Направление/специальность подготовки	27.04.04 Управление в технических системах
Специализация/профиль/программа подготовки	Цифровая обработка сигналов в автономных системах управления
Уровень высшего образования	Магистратура
Форма обучения	Очная
Факультет	Е Оружие и системы вооружения
Выпускающая кафедра	Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
Кафедра-разработчик рабочей программы	Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

КУРС	СЕМЕСТР	ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ (ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ)	ЧАСЫ (по наличию видов занятий)									ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
			ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ	АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ				САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА				
				ВСЕГО	ЛЕКЦИИ	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ	ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	ВСЕГО	КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	КУРСОВАЯ РАБОТА	ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТ. РАБОТЫ	
6	11	5	180	51	17	0	34	129	0	0	129	ЭКЗ.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВО)**

27.04.04 Управление в технических системах

год набора группы: 2024

Программу составили:

Кафедра Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Курицын Александр Николаевич, к.т.н., доцент

Кафедра Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Егоренков Леонид Семенович, к.т.н., старший научный сотрудник,
заведующий кафедрой

Программа рассмотрена

на заседании кафедры-разработчика

рабочей программы **Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ**

Заведующий кафедрой Егоренков Л.С., к.т.н., снс

Программа рассмотрена

на заседании выпускающей кафедры

Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Заведующий кафедрой Егоренков Л.С., к.т.н., снс

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Разделы рабочей программы

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложения к рабочей программе дисциплины

- Приложение 1. Аннотация рабочей программы
- Приложение 2. Технологии и формы обучения
- Приложение 3. Фонды оценочных средств

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-7 — способность осуществлять обоснованный выбор, разрабатывать и реализовывать на практике схемотехнические, системотехнические и аппаратно-программные решения для систем автоматизации и управления
ПСК-4.3 — способность проводить проектно-конструкторские работы по созданию электромеханических и микромеханических устройств систем управления действием малогабаритных летательных аппаратов
ПСК-4.4 — способность разрабатывать комплексированные многофункциональные автономные информационные системы для управления движением малогабаритных летательных аппаратов

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:

ОПК-7

знания:

конструкций, принципов работы и области применения МЭМС;

умения:

ориентироваться в многообразии технологических основ производства микромеханических приборов;

навыки:

применять знания о динамике ЧЭ микромеханических приборов, уравнений движения и передаточных функций микроакселерометров.

ПСК-4.3

знания:

технологий изготовления МЭМС;

умения:

разрабатывать элементную базу МЭМС, удовлетворяющую функциональным требованиям;

навыки:

выбирать элементную базу микромеханических приборов.

ПСК-4.4

знания:

методов выполнения проектных расчетов элементов МЭМС;

умения:

самостоятельно работать с нормативно-технической документацией;

навыки:

применять профессиональные знания нормативной документации, используемой при разработке МЭМС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина **МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ** является дисциплиной **обязательной части блока 1** программы подготовки по направлению 27.04.04 *Управление в технических системах*.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин: **ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ, СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ, ТЕОРИЯ ПОСТРОЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ УСТРОЙСТВ, ТЕОРИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ.**

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин: **ВЫПОЛНЕНИЕ, ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА.**

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

- ОПК-10 — Способен руководить разработкой методических и нормативных документов, технической документации в области автоматизации технологических процессов и производств, в том числе по жизненному циклу продукции и ее качеству
- ОПК-2 — Способен формулировать задачи управления в технических системах и обосновывать методы их решения
- ОПК-3 — Способен самостоятельно решать задачи управления в технических системах на базе последних достижений науки и техники
- ОПК-5 — Способен проводить патентные исследования, определять формы и методы правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, распоряжаться правами на них для решения задач в развитии науки, техники и технологии
- ОПК-6 — Способен осуществлять сбор и проводить анализ научно-технической информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и управления
- ОПК-7 — Способен осуществлять обоснованный выбор, разрабатывать и реализовывать на практике схмотехнические, системотехнические и аппаратно-программные решения для систем автоматизации и управления
- ОПК-8 — Способен выбирать методы и разрабатывать системы управления сложными техническими объектами и технологическими процессами
- ОПК-9 — Способен разрабатывать методики и выполнять эксперименты на действующих объектах с обработкой результатов на основе информационных технологий и технических средств
- ПК-95 — способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности, построению логических умозаключений на основании поступающих информации и данных
- ПСК-4.1 — Способен разрабатывать и реализовывать комплексные математические модели автономных информационных и управляющих систем
- ПСК-4.2 — Способен на основе современной теории управления решать задачи анализа и синтеза автономных информационных и управляющих систем различного назначения, работающих в экстремальных условиях
- ПСК-4.3 — Способен проводить проектно-конструкторские работы по созданию электромеханических и микромеханических устройств систем управления действием малогабаритных летательных аппаратов
- ПСК-4.4 — Способен разрабатывать комплексированные многофункциональные автономные информационные системы для управления движением малогабаритных летательных аппаратов
- УК-1 — Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
- УК-2 — Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
- УК-3 — Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %		
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		ОПК-7	ПСК-4.3	ПСК-4.4
6	11	Раздел 1. Конструкции и принципы работы микроэлектромеханических приборов. 1.1 Место микросистемной техники в системе технических инноваций. Основные понятия и определения. 1.2 Осевые и маятниковые акселерометры.	30	9	3	6	21	15	15	15
6	11	Раздел 2. Технологические основы производства микромеханических приборов. 2.1 Материалы: кристаллы (кремний, арсенид галлия, кремниевые композиты), металлы. 2.2 Выращивание и депонирование тонких пленок (эпитаксия, диффузия, ионная имплантация), литография (фотолитография, электроннолучевая, рентгеновская). 2.3 Травление (изотропное, анизотропное и другие виды). Контроль размерных параметров. 2.4 Изготовление микроструктур (базовые технологии формообразования, микроэлектронные элементы).	40	12	4	8	28	5	5	5
6	11	Раздел 3. Элементная база микромеханических приборов. 3.1 Упругие подвесы и мембраны (жесткость подвесов, главные формы и частоты малых колебаний ЧЭ. Влияние массы упругих элементов на частоты собственных колебаний). Сборка и испытания микроэлектромеханических приборов. 3.2 Прямые преобразователи (емкостные, на МДП-транзисторе, тензометрические, на поверхностно-акустических волнах и на струне). 3.3 Обратные преобразователи (актюаторы) электростатические. Магнитоэлектрические. Электромагнитные.	42	12	4	8	30	30	30	30
6	11	Раздел 4. Динамика ЧЭ микроэлектромеханических приборов. 4.1 Уравнение движения ЧЭ микроакселерометров. 4.2 Передаточные функции ЧЭ микроакселерометров. 4.3 Газовое демпфирование ЧЭ.	39	9	3	6	30	25	25	25
6	11	Раздел 5. Измерительные свойства микромеханических приборов. 5.1 Микроакселерометры прямого преобразования. 5.2 Микроакселерометры компенсационного преобразования.	29	9	3	6	20	25	25	25
Всего за 11 семестр			180	51	17	34	129	100	100	100
Всего по дисциплине			180	51	17	34	129	100	100	100

3.2. Аудиторный практикум

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Тема практического занятия	Объем, ауд. часов
1	Раздел 1. Конструкции и принципы работы микроэлектромеханических приборов.	Емкостной акселерометр типа АЛЕ	6
2	Раздел 2. Технологические основы производства микромеханических приборов.	Литография, травление	4
3		Изготовление микроструктур	4
4	Раздел 3. Элементная база микромеханических приборов.	Прямые и обратные преобразователи	8
5	Раздел 4. Динамика ЧЭ микроэлектромеханических приборов.	Уравнение движения ЧЭ осевого микроакселерометра	6
6	Раздел 5. Измерительные свойства микромеханических приборов.	Ошибки измерения микроакселерометрами	6
Всего за 11 семестр			34

3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Содержание учебного задания	Объем, часов
1	Раздел 1. Конструкции и принципы работы микроэлектромеханических приборов.	Влияние массы упругих элементов на частоту собственных колебаний	13
2		Повторение лекционного материала	4
3		Подготовка к практическим занятиям	4
4	Раздел 2. Технологические основы производства микромеханических	Базовые технологии формирования и сборки микроэлектромеханических	16

	приборов.	приборов	
5	Раздел 3. Элементная база микромеханических приборов.	Повторение лекционного материала	6
6		Подготовка к практическим занятиям	6
7		Преобразователи деформаций на поверхностно-акустических волнах и на струне	14
8	Раздел 4. Динамика ЧЭ микроэлектромеханических приборов.	Повторение лекционного материала	8
9		Подготовка к практическим занятиям	8
10		Газовое демпфирование ЧЭ микроакселерометров и микродатчиков давления	14
11	Раздел 5. Измерительные свойства микромеханических приборов.	Повторение лекционного материала	8
12		Подготовка к практическим занятиям	8
13		Коррекция частотных характеристик и ошибки измерения акселерометров	12
14	Всего за 11 семестр	Повторение лекционного материала	4
15		Подготовка к практическим занятиям	4
			129

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР	НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11				ВПЗ		ДР	ВПЗ		Колл	ДР		ВПЗ				ДР	Вопр. Экз

Условные обозначения:

- ДР – диагностическая работа;
- ВПЗ – вопросы/задания по темам ПЗ;
- Колл – коллоквиум;
- Вопр. Экз – вопросы к экзамену.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы/задания по темам ПЗ;
- коллоквиум;
- вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- экзамен.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература по дисциплине:

1. В. Д. Вавилов. . Микросистемные датчики физических величин. Москва: Техносфера, 2018, эл. рес.
2. В. Я. Распопов. . Микромеханические приборы. М.: Машиностроение, 2007, эл. рес.
3. Р. Г. Джексон. . Новейшие датчики. М.: Техносфера, 2008, 45 экз.

5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

не требуется.

5.3. Периодические издания:

1. Научноёмкие технологии.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. <http://urait.ru> — Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов.;
2. <http://library.voenmeh.ru> — Фундаментальная библиотека БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова;
3. <http://e.lanbook.com> — ЭБС Лань;
4. <http://ibooks.ru> — ЭБС Айбукс.ру - это большой выбор актуальной литературы для вашей библиотеки в электронном виде;
5. <http://www.tnt-ebook.ru> — TNT-EBOOK - Электронно-библиотечная система.

Современные профессиональные базы данных:

1. <https://rusneb.ru> – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. <https://cyberleninka.ru/> - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;
<http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library> - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда фундаментальных исследований.

Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты РФ;
2. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457 - БД ГОСТов собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;
3. <http://www.consultant.ru/>- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

5.5. Программное обеспечение:

1. Adobe Reader;
2. Microsoft Office.

5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционные занятия:

специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными местами по количеству студентов; доска.

6.2. Практические занятия:

1. Проектор;
2. Интерактивная доска;
3. Аудитория с числом посадочных мест не меньше количества обучающихся;
4. Adobe Reader;
5. Microsoft Office.

6.3. Прочее:

1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

Аннотация рабочей программы

Дисциплина **МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ** является дисциплиной **обязательной части блока 1** программы подготовки по направлению 27.04.04 *Управление в технических системах*. Дисциплина реализуется на факультете *Е Оружие и системы вооружения* БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой *Е6 АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ*.

Дисциплина нацелена на формирование *компетенций*:

ОПК-7 способность осуществлять обоснованный выбор, разрабатывать и реализовывать на практике схмотехнические, системотехнические и аппаратно-программные решения для систем автоматизации и управления;

ПСК-4.3 способность проводить проектно-конструкторские работы по созданию электромеханических и микромеханических устройств систем управления действием малогабаритных летательных аппаратов; ПСК-4.4 способность разрабатывать комплексированные многофункциональные автономные информационные системы для управления движением малогабаритных летательных аппаратов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с терминологией, классификацией, конструкцией и принципами работы микромеханических осевых и маятниковых акселерометров. Даны описание и расчет прямых (датчиков перемещений и деформаций) и обратных (датчиков сил и моментов) преобразователей в микромеханическом исполнении. Рассмотрены конструктивные схемы и расчет упругих подвесов и мембран, динамика чувствительных элементов, включающая уравнения движения, передаточные функции, частотные характеристики и функциональные зависимости перемещений чувствительных элементов от измеряемой величины. Даны расчет газового и конструкционного демпфирования, теория и расчет измерительных цепей приборов прямого и компенсационного преобразований, а также основные погрешности измерений, примеры вычислений.

Программой дисциплины предусмотрены следующие **виды контроля**:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы/задания по темам ПЗ;
- коллоквиум;
- вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., **180 ч**. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (**17 ч.**), практические занятия (**34 ч.**), самостоятельная работа студента (**129 ч.**).

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 ч., из них 51 ч. аудиторных занятий, и 129 ч., отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы	Рекомендуемая литература	Трудоемкость, час.
Раздел 1. Конструкции и принципы работы микроэлектромеханических приборов.		
Влияние массы упругих элементов на частоту собственных колебаний	В. Я. Распопов. . Микромеханические приборы: М.: Машиностроение, 2007 (1) Р. Г. Джексон. . Новейшие датчики: М.: Техносфера, 2008 (Выборочно по разделам)	13
Повторение лекционного материала	В. Д. Вавилов. . Микросистемные датчики физических величин: Москва: Техносфера, 2018 (1, 2)	4
Подготовка к практическим занятиям		4
Итого по разделу 1		21
Раздел 2. Технологические основы производства микромеханических приборов.		
Базовые технологии формирования и сборки микроэлектромеханических приборов	В. Я. Распопов. . Микромеханические приборы: М.: Машиностроение, 2007 (2) В. Д. Вавилов. . Микросистемные датчики физических величин: Москва: Техносфера, 2018 (1)	16
Повторение лекционного материала		6
Подготовка к практическим занятиям		6
Итого по разделу 2		28
Раздел 3. Элементная база микромеханических приборов.		
Преобразователи деформаций на поверхностно-акустических волнах и на струне	В. Я. Распопов. . Микромеханические приборы: М.: Машиностроение, 2007 (2) В. Д. Вавилов. . Микросистемные датчики физических величин: Москва: Техносфера, 2018 (1)	14
Повторение лекционного материала		8
Подготовка к практическим занятиям		8
Итого по разделу 3		30
Раздел 4. Динамика ЧЭ микроэлектромеханических приборов.		
Газовое демпфирование ЧЭ микроакселерометров и микродатчиков давления	В. Я. Распопов. . Микромеханические приборы: М.: Машиностроение, 2007 (3) В. Д. Вавилов. . Микросистемные датчики физических величин: Москва: Техносфера, 2018 (3)	14
Повторение лекционного материала		8
Подготовка к практическим занятиям		8
Итого по разделу 4		30
Раздел 5. Измерительные свойства микромеханических приборов.		
Коррекция частотных характеристик и ошибки измерения акселерометров	В. Я. Распопов. . Микромеханические приборы: М.: Машиностроение, 2007 (5) В. Д. Вавилов. . Микросистемные датчики физических величин: Москва: Техносфера, 2018 (8)	12
Повторение лекционного материала		4
Подготовка к практическим занятиям		4
Итого по разделу 5		20

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, включают в себя:

- диагностическая работа
- вопросы/задания по темам ПЗ;
- коллоквиум;
- вопросы к экзамену;
- экзамен.

Критерии оценивания

Диагностическая работа

Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

- при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
- при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

Вопросы/задания по темам ПЗ

Примерные варианты тематики вопросов/заданий по темам ПЗ:

- ёмкостный акселерометр типа АЛЕ;
- литография, травление. Изготовление микроструктур;
- прямые преобразователи и обратные преобразователи;
- уравнение движения ЧЭ осевого микроэлектроакселерометра;
- ошибки измерения микроакселерометрами.

Ответы оцениваются преподавателем по четырёхбалльной системе; оцениваются корректность и полнота ответа.

Оценка выставляется согласно следующим критериям:

«отлично» - глубокое усвоение материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении вопроса, правильно обоснованные решения, владение разносторонними навыками и приемами;

«хорошо» - знание программного материала - грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических задач;

«удовлетворительно» - усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении материала, затруднения в выполнении практических заданий;

«неудовлетворительно» - незнание материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ.

Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при получении обучающимися оценки не ниже, чем "удовлетворительно".

Полученные оценки учитываются при выставлении оценки по итогам экзамена по дисциплине.

Коллоквиум

Проводится в устной форме. На коллоквиум выносится часть материала экзамена; оценка за коллоквиум учитывается при выставлении оценки по итогам экзамена по дисциплине.

Ответ оценивается преподавателем по четырёхбалльной системе; оцениваются корректность и полнота ответа.

Оценка выставляется согласно следующим критериям:

«отлично» - глубокое усвоение материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении вопроса, правильно обоснованные решения, владение разносторонними навыками и приемами;

«хорошо» - знание программного материала - грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических задач;

«удовлетворительно» - усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении материала,

затруднения в выполнении практических заданий;

«неудовлетворительно» - незнание материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ.

По результатам сдачи обучающимся коллоквиума преподаватель выставляет оценку согласно вышеуказанным критериям, при этом контрольное мероприятие считается пройденным успешно в случае получения обучающимся оценки не ниже, чем "удовлетворительно".

Перечень выносимых на коллоквиум вопросов:

1. Основные факторы развития микросистемной техники.
2. Классифицируйте микросистемную технику с учетом сложности и массогабаритных характеристик.
3. Как влияют компоненты микросистемной техники на характеристики измерительных и исполнительных средств нового поколения.
4. Опишите основные характеристики сенсоров.
5. Какими факторами определяется погрешность измерений сенсоров.
6. Какого рода погрешность можно устранить с помощью калибровки сенсора.
7. Опишите основные конструктивные варианты элементов микромеханических сенсоров. Дайте характеристику их свойств.
8. Какие физические механизмы определяют проявление пьезоэффекта.
9. Каков принцип действия и область применения емкостных сенсоров.
10. Опишите область применения, конструктивные особенности тензорезисторов.
11. Опишите принцип действия датчика давлений. Для чего применяется мостовая измерительная схема.
12. Опишите назначение, общую классификацию акселерометров.
13. Опишите основные конструктивные варианты пьезоэлектрических акселерометров. Дайте характеристику их свойств.
14. Какие физические механизмы определяют проявление обратного пьезоэффекта.
15. Опишите принцип работы биморфных пьезоэлектрических акселерометров.
16. Опишите основные конструктивные варианты емкостных актюаторов. Дайте характеристику их свойств.
17. Опишите основные конструктивные варианты термомеханических актюаторов. Дайте характеристику их свойств.
18. Опишите основные конструктивные варианты электромагнитных актюаторов. Дайте характеристику их свойств.
19. Опишите принцип работы электромагнитных акселерометров.
20. Какие физические механизмы определяют проявление эффекта «памяти формы»?
21. Какие механизмы активации используют для создания устройств микросмещения и микропозиционирования? Каковы конструктивные особенности этих устройств.
22. Опишите область применения, конструктивные особенности генераторов-вибраторов.
23. Перечислите варианты конструкций планарных и объемных микроиндукторов.
24. Как зависит добротность катушки индуктивности от занимаемой ею площади.
25. Назовите основные типы регулируемых конденсаторов.
26. Опишите конструкцию и принцип действия микроантенны.
27. Опишите конструкции и принцип действия микрореле и коммутаторов.
28. Приведите примеры применения микросистемных компонентов в высокочастотных устройствах.
29. Назовите сходные черты и различие технологических процессов микроэлектроники и микромеханики.
30. Каково основное конструктивно-топологическое отличие элементов микроэлектроники и микросистемной техники?
31. Опишите основные технологические процессы, используемые в микросистемной технике.
32. Опишите основные операции и область применения технологии с использованием «жертвенного» слоя.
33. Опишите основные операции и область применения технологий анизотропного жидкостного и глубокого реактивно-ионного травления.

Вопросы к экзамену

Вопросы к экзамену оформляются в виде билета. Примерные варианты экзаменационных билетов:

Билет № 1

1. Математическое описание чувствительного элемента как динамической системы.
2. Определение добротности интегральных чувствительных элементов.

Билет № 2

1. Особенности микросистемных чувствительных элементов датчиков линейных ускорений.
2. Упругие подвесы и мембраны.

Билет № 3

1. Особенности микросистемных чувствительных элементов датчиков угловых ускорений.
2. Емкостные преобразователи перемещений.

Билет № 4

1. Микроэлектронные преобразователи и узлы, встраиваемые в интегральные датчики ускорений.
2. Измерительные свойства микромеханических устройств.

Билет № 5

1. Уравнение движения и передаточная функция микродатчика ускорения.
2. Электростатические приводы.

Билет № 6

1. Разработка структурной схемы и полной передаточной функции микросистемного акселерометра.
2. Тензорезистивные преобразования деформаций.

Билет № 7

1. Особенности газодинамического демпфирования микромеханических маятников акселерометров.
2. Формирование информации об измеряемом ускорении.

Билет № 8

1. Эффект влияния вторичных колебаний инерционного тела на первичные при воздействии постоянной и переменной угловых скоростей основания.
2. Базовые технологии формообразования.

Билет № 9

1. Теория многомерных упругих подвесов, требования к их структуре построения и параметрам.
2. Уравнение движения и передаточная функция микродатчика давления.

Билет № 10

1. Сравнительный анализ различных конструктивных схем инерциальных измерителей.
2. Преобразователи деформаций на поверхностно-акустических волнах.

Экзамен

Экзамен является формой итогового контроля знаний обучающегося и проводится в соответствии с расписанием в период экзаменационной сессии.

Положительная оценка может быть получена только при выполнении предусмотренных рабочей программой контрольных мероприятий.

Оценка выставляется согласно следующим критериям:

«отлично» - глубокое усвоение материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении вопроса, правильно обоснованные решения, владение разносторонними навыками и приемами;

«хорошо» - знание программного материала - грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических задач;

«удовлетворительно» - усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении материала, затруднения в выполнении практических заданий;

«неудовлетворительно» - незнание материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ.

При условии полного и своевременного выполнения всех предусмотренных рабочей программой дисциплины контрольных мероприятий допускается оформлять экзамен по дисциплине на основании тестирования: 20 вопросов, 1 академический час.

Критерии оценивания – правильные ответы на поставленные вопросы;

показатель оценивания – процент верных ответов на вопросы;

шкала оценивания – выделено 4 уровня освоения компетенций:

- высокий, оценка "отлично", более 80 % правильных ответов;
- достаточный, оценка "хорошо", от 60 до 80 % правильных ответов;
- пороговый, оценка "удовлетворительно" от 51 до 60 % правильных ответов;
- критический, оценка "неудовлетворительно", менее 50 % правильных ответов.

Паспорт фонда оценочных средств

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %			НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		ОПК-7	ПСК-4.3	ПСК-4.4	
6	11	Раздел 1. Конструкции и принципы работы микроэлектромеханических приборов.	30	9	3	6	21	15	15	15	Вопросы к экзамену, Коллоквиум, Вопросы/ задания по темам ПЗ
6	11	Раздел 2. Технологические основы производства микромеханических приборов.	40	12	4	8	28	5	5	5	Вопросы к экзамену, Вопросы/ задания по темам ПЗ, Коллоквиум
6	11	Раздел 3. Элементная база микромеханических приборов.	42	12	4	8	30	30	30	30	Вопросы к экзамену, Коллоквиум, Вопросы/ задания по темам ПЗ
6	11	Раздел 4. Динамика ЧЭ микроэлектромеханических приборов.	39	9	3	6	30	25	25	25	Вопросы/ задания по темам ПЗ, Вопросы к экзамену, Коллоквиум
6	11	Раздел 5. Измерительные свойства микромеханических приборов.	29	9	3	6	20	25	25	25	Вопросы к экзамену, Вопросы/ задания по темам ПЗ, Коллоквиум
Всего за 11 семестр			180	51	17	34	129	100	100	100	
Всего по дисциплине			180	51	17	34	129	100	100	100	

Критерии оценивания

ОПК-7

Вопросы открытого типа:

- № 1 Что относится к микросистемной технике?
- № 2 Что такое интегральный датчик?
- № 3 В состав интегрального датчика входят:
- № 4 Микроэлектромеханические системы могут состоять из
- № 5 Приведите примеры устройств, которые были созданы на основе МЭМС-технологий
- № 6 По виду движений инерционных масс акселерометры делятся на
- № 7 Акселерометры делятся по виду движений инерционных масс, виду измеряемого сигнала и по принципу измеряемого сигнала на:
- № 8 К важнейшим техническим характеристикам микродатчиков давления (МДД) относятся
- № 9 Процесс изготовления подложек кремния на изоляторе с помощью склеивания двух пластин выглядит следующим образом:
- № 10 С помощью какого математического выражения могут быть найдены параметры микроакселерометра, состоящего из простой пружины, груза и демпфера?

Вопросы закрытого типа:

- № 1 В чем заключается основное отличие осевого микроакселерометра от маятникового?
- № 2 Уравнение движения инерционной массы, где центр масс и геометрический центр подвеса совпадают и направление действующего ускорения совпадает с одной из осей x , y , z , являющаяся осью чувствительности, например с осью y , имеет вид
- № 3 Уравнение движения инерционной массы чувствительного элемента маятникового микроакселерометра при условии, что ускорение a_y совпадает с осью y , имеет вид
- № 4 В реальных микроакселерометрах перемещение инерционной массы измеряется
- № 5 К какому типу микроакселерометров относятся МА, изображенные на рисунке?
- № 6 К какому типу микроакселерометров относятся МА, изображенный на рисунке?
- № 7 Укажите основные принципиальные схемы чувствительных элементов маятниковых микромеханических акселерометров
- № 8 Перечень материалов для МЭМС-устройств включает в себя проводники, полупроводники и изоляторы типа
- № 9 Какой материал наиболее часто используется в МЭМС-устройствах?
- № 10 Какие существуют дефекты кремниевых пластин?

ПСК-4.3

Вопросы открытого типа:

- № 1 Какие физические величины (параметры) могут измеряться с помощью интегральных датчиков?
- № 2 В каких областях могут применяться интегральные датчики?
- № 3 По каким параметрам стандартизируются выходные сигналы интегральных датчиков?
- № 4 Что входит в состав интегрального датчика?
- № 5 У печатных плат для традиционного монтажа плотность монтажа характеризуется ...
- № 6 В зависимости от степени жесткости основания различают печатные платы:
- № 7 Что такое печатный монтаж?
- № 8 Дайте определение понятию "интегральная схема"
- № 9 Какие бывают приемы интеграции при сборке изделий электронной техники?
- № 10 На какие виды подразделяются микроакселерометры по виду измеряемого ускорения?

Вопросы закрытого типа:

- № 1 В чем заключается основное отличие осевого микроакселерометра от маятникового?
- № 2 Уравнение движения инерционной массы, где центр масс и геометрический центр подвеса совпадают и направление действующего ускорения совпадает с одной из

- осей x, y, z , являющаяся осью чувствительности, например с осью y , имеет вид
- № 3 Уравнение движения инерционной массы чувствительного элемента маятникового микроакселерометра при условии, что ускорение ay совпадает с осью y , имеет вид
- № 4 В реальных микроакселерометрах перемещение инерционной массы измеряется
- № 5 К какому типу микроакселерометров относятся МА, изображенные на рисунке?
- № 6 По каким признакам можно произвести классификацию микромеханических гироскопов?
- № 7 Какие режимы перемещения инерционных масс известны?
- № 8 Перечень материалов для МЭМС-устройств включает в себя проводники, полупроводники и изоляторы типа
- № 9 Какой материал наиболее часто используется в МЭМС-устройствах?
- № 10 Какие существуют дефекты кремниевых пластин?

ПСК-4.4

Вопросы открытого типа:

- № 1 Микроакселерометры подразделяются:
- № 2 Датчики давления характеризуются составляющими погрешности...
- № 3 В чем отличии поверхностной микрообработки от объемной?
- № 4 Перечислите основные технологические процессы производства МЭМС
- № 5 Назовите основные технические характеристики микродатчиков давления.
- № 6 Микроэлектромеханические приборы могут применяться в медицине, энергетике, нефтегазовой промышленности, автомобилестроении, обороне. Сопоставьте области применения с соответствующими отраслями.
- № 7 МЭМС могут применяться для измерения физических величин в механической, тепловой, химической, оптической, магнитной и электрической областях. Какие физические величины измеряются в каждой конкретной области? Указать соответствие
- № 8 По принципу действия микродатчики давления делятся на:
- № 9 Каким образом в микроакселерометрах обеспечивается реализация выходного сигнала и принципа измерения?
- № 10 На какие виды подразделяются микроакселерометры по виду измеряемого ускорения?

Вопросы закрытого типа:

- № 1 По какой формуле определяется удлинение консоли за счет пьезоэффекта?
- № 2 По какой формуле определяется удлинение консоли при нагревании?
- № 3 По какой формуле определяется изгиб биморфной консоли при нагревании?
- № 4 Какие виды литографии бывают?
- № 5 В качестве источника тепла для испарения материала могут использоваться:
- № 6 Термическое напыление использует два физических процесса:
- № 7 Нанесение пленок при производстве МЭМС может быть разделено на 2 подгруппы:
- № 8 Травление вещества иными словами это нанесение или его удаление
- № 9 Дайте определение понятию литография
- № 10 Процесс изготовления МЭМС-устройства включает в себя ряд операций с исходными материалами: литографию и травление